

電壓操控奈米磁性元件的新穎機制研發: 利用電場引導氫化磁性材料的磁矩轉向

Wen-Chin Lin (林文欽) Department of Physics, National Taiwan Normal University Email: <u>wclin@ntnu.edu.tw</u>



摘要

本計畫提出透過電場操控以氫離子在磁性金屬材料中移動,以操控材料的磁性特性,最終目標為磁紀錄元件的讀寫。此構想需要從物理機制、材料選擇等層面突破多重挑戰,例如元件中的H原子的來源、H原子的操控機制、H原子的擴散的速率及反應時間等。本團隊預計採用Mg合金為儲氫材料,預選擇Pd-相關垂直磁性合金薄 膜透過上下電極施予電壓,造成局域電場以驅動儲氫材料內的氫重新擴散分布。

磁性儲氫薄膜探究 (1) CoPd、FePd 磁性合金薄膜及微結構

目標

1.磁性儲氫薄膜成長與最佳化
2.利用電壓對磁性儲氫薄膜之磁性操控
3.應用於穿隧磁阻(MTJ)元件

Chirality-Induced Noncollinear Magnetization and Asymmetric Domain-Wall Propagation in Hydrogenated CoPd Thin Films, 磁手信導致非線性磁化及不對稱磁疇壁傳播於氫化鈷鈀薄膜 ACS Appl. Mater. Interfaces (2022)

Exchange-bias dependent diffusion rate of hydrogen discovered from evolution of hydrogen-induced noncollinear magnetic anisotropy in FePd thin films 氫擴散速率受FePd薄膜磁化狀態之影響 PRB (2021)



不同磁化狀態下: (a)去磁態、(b)-1000高斯磁化、 (c)+1000高斯磁化的鐵鈀薄膜,自氫化開始隨時間不間 斷地量測磁滯曲線。(d)殘磁比例、(e)矯頑磁場隨氫化 時間之變化圖。此數據顯示,去磁化樣品,相較於 1000高斯磁場飽和樣品,其氫化擴散速度明顯較慢。



鐵鈀薄膜磁區隨磁場演化之情況。左、右兩圖分別為去磁狀態及1000高斯飽和磁化後,隨著曝氫之後的時間逐次(n)測量的結果。紅框特別顯示矯頑磁場附近的磁區影像,隨時間(n)而轉變。左圖(去磁狀態)在n=7開始變化,右圖(1000高斯飽和磁化後)在n=1即開始變化。此結果顯示,曝氫時的初始磁化狀態,會明確改變氫擴散及產生效應的速度。



左圖:在有和沒有電漿處理的區域之間,垂直分量產生了橫向反 鐵磁耦合。

右圖:在磁化反轉過程中,表面電漿處理過區域中的磁疇壁有不 對稱傳播的現象。



(a) 圖案化CoPd合金樣品之垂直極化 MOKE 影像。區域A 受過表面電漿處 理,區域 B 和 C 則否。(b) 圖示區域A之剖面,不同深度下的成分分佈依 序為:氧化-CoPd/Pd-高合金比例/CoPd。區域 B 和 C 只有相對較薄的氧化 層在表面。紅色箭頭指示不同區域的磁化方向。(c-h) 縱向及極化MOKE 磁滯曲線,分別量測於初始真空VAC-0th 階段(c and d)、首次氫化H₂-1st 階 段 (e and f)、以及再次真空 VAC-1st 階段 (g and h)。黑色、紅色、藍色曲 線分別表示區域 A、B、C的量測數據。(h)的小圖將區域A的磁製曲線拆解 成上、下層的兩部份貢獻.

Co (3 nm)

Mg (25 nm) Fe (10 nm)

d(5nm)/Co(3 nm)/Mg(25 nm)/Fe(10 nm)

0

Magnetic Field (Oe)

-1000



使用原子力顯微鏡對Pd/Co/Mg多層膜進行氫化前後的表面形貌量測圖。右下角的放大圖中可以明顯看到樣品氫化之後,產生奈米尺寸的凹洞。(c)剖面曲線顯示,樣品表面形貌由0.1奈米的平整度,受氫化而轉變為~0.5 奈米深度的凹洞陣列。(d)呈現曝氫前後的磁滯曲線量測結果。氫化造成矯頑磁力大幅增加,但是再次回到真空環境,並不會使磁性回復初始狀態,顯示其為不可逆效應。(e)樣品氫化前後所量測之X光晶格量測曲線,顯示室溫、1大氣壓的氫化條件,成功地將原來的純Mg轉變為氫化鎂MgH₂。

元件應用 - 穿隧磁阻元件 (MTJ)

下圖為子計畫主持人:淡江物理洪振湧教授研究團隊所製備的穿隧磁阻元件,使用 氧化鋁介面可達14%的磁阻變化。基於此成功可行的MTJ架構,我們將逐步加入磁 性氫化層,藉以研究氫操控與磁阻變化之關聯性。



(a) Pd/Co/Mg/Fe多層膜結構氫化前後所量測的縱向MOKE磁滯曲線。(b)樣品氫化前後的殘磁比對於水平量測角度所繪製之數據圖,由此可明顯看出其明顯地磁性變化。(c)、(d)上層Co與下層Fe氫化前後的矯頑磁場(Coercivity)對於水平量測角度所 繪製之數據圖。上層Co氫化後的矯頑磁場由200 Oe增加一倍為400 Oe。下層Fe氫 化後的矯頑磁場由80 Oe減少約10%為76 Oe。



10.50

10.49 0

10.48

^{10.47} b

1000

Pd(5nm)/Co(3 nm)/Mg(25 nm)/Fe(10 nm)

0

Magnetic Field (Oe)

1000

40 degree

-1000

(%) _{0.3}

ratio

MR





在2 nm-FePd/[Co/Pt]4 的多層膜樣品中,氫化導致垂直磁性轉為傾斜,(a)其垂直殘磁率由0.8隨時間遞減為0.4,(b)當樣品回復真空環境之後,約1小時可 以使垂直殘磁率再回復到0.8。(c)氫化造成垂直磁易軸轉為傾斜的現象可以重複多次變化。

未來展望

本計畫執行至今約10個月	,本團隊除了將之前在CoPa	1、FePd的研究成果陸續
發表之外,已經開發數個	與鎂儲氫特性相關的多層膜	系統。我們對這些材料
系統的氫化磁性行為已有	充分掌握,將陸續研究其受	:電壓、電流之操控,進
而與正在研究中的MTJ系	統整合 ,希望能在下一年度	有更明確的應用效能。